

## О ВОЗМОЖНОМ ТИПЕ НЕУСТОИЧИВОСТИ ПРИ МОНОПОЛЯРНОЙ ИНЖЕКЦИИ

24

*В.Б. Сандомирский, А.Г. Ждан*

Покажем, что эффект исчезновения локальных уровней при экранировании свободными носителями, теоретически предсказанный в работе [1] и экспериментально наблюдавшийся в работе [2], может приводить при монополярной инжекции из контакта (т.е. в режиме токов, ограниченных пространственным зарядом – ТОПЗ) к S-образной вольт-амперной характеристике.

Рассмотрим тонкий диэлектрический слой толщиной  $L$ , в котором имеется высокая концентрация  $N$ , моноэнергетических электронных ловушек глубиной  $E_t$ . Инжектируемые из контакта электроны распределяются между ловушками и зоной проводимости. Свободные электроны экранируют ловушки и  $E_t$  уменьшается. При критическом напряжении  $V = V_1$ , когда концентрация свободных электронов станет достаточно большой  $n = n_1$ , начнется лавинообразное уменьшение  $E_t$  и увеличение  $n$  вследствие освобождения электронов из ловушек, а на вольт-амперной характеристике появится область отрицательной проводимости. Этот процесс является, в сущности, моттовским переходом, вызванным инжекцией [3].

Получим вольт-амперную характеристику рассматриваемого диэлектрического диода в рамках простейшей модели ТОПЗ [4]. Исходная система уравнений имеет вид:

$$i = q\mu n(V/L), \quad (1)$$

$$CV/qL = n + n_t, \quad (2)$$

$$n_t = \frac{nN_t \theta(E_t)}{n + N_{ct}}; \quad N_{ct} = N_c e^{-E_t/kT} = N_{ct}^0 e^{n/\bar{n}}; \quad \theta(z) = \begin{cases} 1, & z > 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}, \quad (3)$$

$$E_t = E_{t0} - kT \frac{n}{\bar{n}}; \quad \bar{n} \approx \frac{m\epsilon(kT)^2}{2\pi^3 h^2 q^2}, \quad (4)$$

где  $i$  – плотность тока,  $\mu$  – подвижность электронов,  $C = \epsilon/4\pi L$  – межэлектродная геометрическая емкость,  $\epsilon$  – диэлектрическая проницаемость,  $q$  и  $m$  – заряды и масса электрона,  $N_c$  – эффективная плотность

состояний в зоне проводимости. Феноменологическое выражение (4) для сдвига уровня можно получить аналитически аппроксимируя численную кривую, полученную в работе [5]. Подставляя уравнение (3) в (2) и дифференцируя полученное выражение по  $n$ , имеем соответственно:

$$CV/qL = n + [nN_c \theta(E_t)/(n + N_{ct}^0 e^{n/\bar{n}})], \quad (5)$$

$$\frac{C}{qL} \frac{dV}{dn} = 1 + N_c \left\{ \frac{N_{ct}^0 e^{n/\bar{n}} (\bar{n} - n)}{(n + N_{ct}^0 e^{n/\bar{n}})^2} \theta(E_t) - \frac{n}{n + N_{ct}^0 e^{n/\bar{n}}} \delta(E_t) \right\}. \quad (6)$$

Подставляя  $n(V)$ , определенную из формулы (5), в уравнение (1) получим вольт-амперную характеристику  $-j(V)$ . Из равенства (6) следует, что всегда существует область  $dV/dn < 0$ , которой отвечает область отрицательной проводимости на вольт-амперной характеристике. Качественно функция  $n(CV/qL)$  изображена на рисунке. Соответствующие характерные точки:

$$n_1 = \bar{n} \left( \frac{E_{t0}}{kT} - \ln \frac{N_c}{\bar{n}} \right); \quad (7a) \quad V_1 = \frac{qL}{C} \left[ \bar{n} \left( \frac{E_{t0}}{kT} - \ln \frac{N_c}{\bar{n}} \right) + \frac{N_t}{2} \right]; \quad (7b)$$

$$n_2 = \bar{n} E_{t0} / kT; \quad (7c) \quad V_2 = \frac{qL}{C} \bar{n} E_{t0} / kT. \quad (7d)$$

Отметим, что вследствие сдвига уровней обычная область резкого нарастания тока на вольт-амперной характеристике токов, ограниченных пространственным зарядом после заполнения ловушек в данном случае переходит в S-образную, т.е.  $V_1 < V < V_2$  — напряжения заполнения ловушек.

Оценка характерного времени развития флюктуации в области неустойчивости дает:

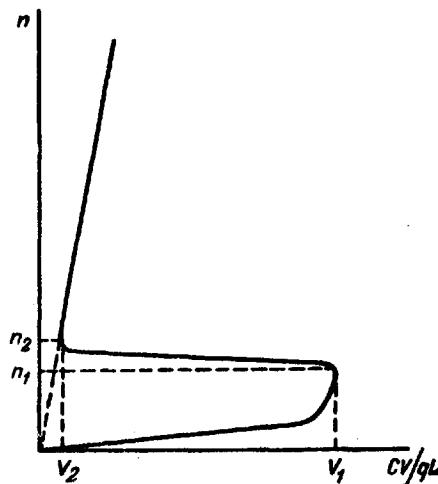
$$\Delta t = \frac{\tau_{t0} e^{-E_{t0}/kT}}{[N_t/(2\pi \ln N_c/\bar{n}) - 1]}, \quad (8)$$

где  $\tau_{t0} = \frac{1}{\langle vS_t \rangle N_c}$ ,  $v$  — тепловая скорость электрона, а  $S_t$  — сечение захвата ловушки.

Аналогичный моттовский переход (металлизация при инжекции) может осуществляться и в системе с высокой концентрацией слабо ионизованных доноров. Если последняя достаточно велика, то система будет неустойчива и перейдет в состояние с высокой проводимостью уже при  $V = 0$ . Другими словами, оказывается, что  $V_2 < 0$ .

Аналогичные по природе эффекты могут возникать и вследствие действия контактных полей и эффекта поля (металлизация приконтактной или приповерхностной области, или всего высокоомного слоя, если он достаточно тонкий).

Разумеется, что подобные явления могут происходить и в комбинации с ударной ионизацией, двойной инжекцией, эффектом Пула – Френкеля и т.д., приводя к S-образной вольт-амперной характеристике и металлизации системы.



Оценим толщину диэлектрического слоя, при которой возможна металлизация при инжекции, используя формулу (7б). Полагая  $V_1/L = 5 \cdot 10^6 \text{ в/см}$ ,  $N = 10^{19} - 10^{21} \text{ см}^{-3} > n(E_{\text{ф}}/kT)$ , получаем  $L \approx 10^{-5} + 10^{-7} \text{ см}$ . Таким образом, данный эффект, по-видимому, может реализоваться в очень тонких сильно дефектных слоях.

Можно предположить, что известное явление переключения в стеклообразных полупроводниках [6] связано с металлизацией при инжекции, облегченной эффектом Пула – Френкеля.

Авторы благодарят В.Л.Бонч-Бруевича за полезные обсуждения.

Институт радиотехники  
и электроники  
Академии наук СССР

Поступило в редакцию  
18 декабря 1968 г.

#### Литература

- [1] В.Л.Бонч-Бруевич. ФТТ, 2, 177, 1959.
- [2] А.А.Рогачев. ФТТ, 8, 187, 1965.
- [3] Дж. Займан. Принципы теории твердого тела. М., Изд. Мир, 1966, стр. 178.
- [4] R. S. Muller. Solid State Electr., 6, 25, 1963.
- [5] В.Л.Бонч-Бруевич, В.Б.Гласко. Оптика и спектроскопия, 14, 495, 1963.
- [6] Б.Т.Коломиец, Э.А.Лебедев. Радиотехника и электроника, 8, 2097, 1963; S. R. Ovshinsky. U. S. patent, № 3271-591, cl. 307-885, 1963.